金属超伝導体MgB2のMgとBの比率の違いによる

超伝導特性の評価

城戸 要

平成 23 年 2 月 22 日

目 次

第1章	序論	1
1.1	はじめに.................................	1
1.2	磁束ピンニング機構	4
1.3	磁束クリープ	5
1.4	不可逆磁界	5
1.5	線材化法	6
	1.5.1 PIT 法	6
	1.5.2 拡散法	7
	1.5.3 PICT 法	7
1.6	本研究の目的	8
筆 2音	宝駼	10
		10
2.1	□ □ 八	10
2.2	実験方法....................................	11
	2.2.1 SQUID 磁力計による直流磁化法	12
第3章	実験結果と検討	15
3.1	J_{c} -B特性	15
3.2	$F_{\rm p}$ -B 特性	18
第4章	まとめ	19

表目次

2.1	試料の比率				•												•					•									11	-
-----	-------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---

図目次

1.1	磁束線のオーダーパラメータと磁束密度の構造・・・・・・・・・・・・・・・	5
1.2	不可逆曲線	6
1.3	PICT (powder-in-closed-tube) 法	8
1.4	MgB2 の結晶構造	9
2.1	試料の焼成温度と焼成時間..........................	12
2.2	四方向から磁束線が侵入した場合の流れ方と電流が流れる微小幅 $\mathrm{d}x$ の帯	
	に囲まれた領域	13
2.3	四方向から磁束線が侵入した場合の増磁過程(下)と減磁過程(上)における	
	磁束密度の空間分布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
3.1	各試料の Jc - B 特性	16
3.2	$1 \mathrm{T}$ での各試料の Mg 量に対する $J\mathrm{c}$	17
3.3	3 T での各試料の Mg 量に対する Jc	17
3.4	各試料の規格化 F_{p} - B 特性	18

第1章 序論

1.1 はじめに

1908年、それまで永久気体であると考えられていたヘリウムの液化に成功したオラン ダのKamerlingh-Onnesは、極低温での自由電子に関するDrude-Lorentz 理論を検証する ために1K近くまでの金属の電気抵抗を調べていた。1911年、当時最も純度が高かった 水銀を液体ヘリウムで冷却していったとき、4.2Kで水銀の電気抵抗が突然測定不能なく らいに小さくなることを発見し、この状態を超伝導状態と名づけた。こうして、水銀が超 伝導体として初めて発見された。その後今日までに、超伝導体は単体元素や合金、化合物 等に多数存在することが発見されている。

超伝導発見後、しばらくはその分野において大きな進展はなかったとはいえ、1957年に 金属超伝導体における超伝導の発現機構が Bardeen、Cooper、Schrieffer が発表した BCS 理論で説明された。BCS 理論において T_c は 40 K を超えないであろうと考えられていた。 しかし、1986年に Bednorz と Müller により酸化物高温超伝導体が発見され、超伝導フィー バーといえる程の社会現象を引き起こした。工業的には高温超伝導体とは、25 K 以上の T_c を持つ物質を指す。初めて発見された第一世代となる高温超伝導体 La-Ba-Cu-O に続いて、 T_c が液体窒素温度 (77.3 K) を超えた最初の高温超伝導体 Y-Ba-Cu-O、そして T_c -105 K の Tl-Ba-Ca-Cu-O 等がある。また、試薬として販売されていた MgB₂ が、2001年に青山 学院大学の秋光純教授らにより金属系では最も高い T_c である約 39 K を示す超伝導体であ ることが発見された。

ここで超伝導体の簡単な特性について触れると、まず超伝導体はある一定の温度下、磁 界下でないと超伝導状態を示さない。それぞれの超伝導状態から常伝導状態に移行する 値は臨界温度 T_c、臨界磁界 B_c と呼ばれ、物質ごとに異なる値を持つ。さらに超伝導体の

特徴としては、電気抵抗がゼロであることと、1933年に Meissner と Ochsenfeld により発 見された完全反磁性である。すなわち、超伝導体の外から磁界 H_e をかけても超伝導体内 の磁束密度 B はゼロに保たれる。超伝導体は常伝導状態においてはこうした反磁性を示 さず、外部の磁束は内部に一様に侵入しており、この状態から温度を下げて超伝導状態と した時にも完全反磁性が実現する。このような完全反磁性の現象を Meissner 効果という。 実際には、磁束は超伝導体の表面から数十 nm 程度内部に侵入している。しかし通常の場 合、超伝導試料のサイズに比べてこの厚さは無視でき、ほぼ試料全体で磁束が排除されて いるとみなすことが出来る。

さらに超伝導体は磁性の振る舞いの違いにより第1種超伝導体と第2種超伝導体に分類 される。第1種超伝導体は B_c 以下の磁界までは Meissner 効果を示し、それ以上の磁界で は超伝導状態は消滅する。第2種超伝導体でも同様に B_{c1} 以下の磁界までは Meissner 効 果を示すが、それ以上の磁界では超伝導体内に磁束の侵入を許しながらも、超伝導状態 を保とうとする。この Meissner 効果が失われる磁界を下部臨界磁界 B_{c1} と呼ぶ。さらに 超伝導体内に侵入する磁束量が増加し、超伝導体が消失する磁界を上部臨界磁界 B_{c2} と呼 ぶ。第1種超伝導体の B_c に比べ非常に高い B_{c2} を有することから高磁界応用では第2種 超伝導体が用いられる。

また B_{c1} と B_{c2} の間の状態は超伝導体内に磁束線が侵入していることから混合状態と呼 ばれるが、ほとんどの応用ではこの混合状態下での利用となる。混合状態下において、超 伝導体内に磁束線が侵入していることを考えると、超伝導電流の影響で磁束線は Lorentz 力を受ける。超伝導体内に流れる電流密度をJ、侵入した磁束線の磁束密度をBとすると、 磁束線が受ける Lorentz 力 F_L は、 $F_L = J \times B$ と表せる。もし磁束線がこの F_L による駆 動力を受けて速度vを持つとすると、電磁誘導により $E = B \times v$ の電界が発生すること になり、損失が生じる。こうした損失をなくすためには、磁束線の運動を止める必要があ り、このことを磁束ピンニングと呼ぶ。実際には Lorentz 力を打ち消す力が必要であり、 この単位体積当たりの力をピン力密度 F_p と呼ぶ。Lorentz 力 F_L がピン力密度 F_p を超え なければ電界が発生せず、電流を電気抵抗なく流せる。この最大の電流密度を臨界電流密 度と呼ぶ。そのため超伝導体の工学応用のためには臨界電流密度 J_c がとても重要となる。 2001年に発見され大きな注目を集めた MgB_2 の臨界温度はおよそ 39 K であり、酸化物 超伝導体と比較すれば低いが、酸化物特有の複雑な結晶構造は持たず、金属でも軽い物質 のために加工が容易であり、原材料となる Mg と B も安価であることのために応用の期待 が高まっている。さらに 20 K 程度での応用が可能になれば、液体水素や冷凍機による低 負荷での運用が可能となるため、冷却コストの低減が期待できる。したがって、20 K 近 傍での J_c 特性向上が MgB_2 の利用の鍵となる。したがって、この J_c 決定のメカニズムを 明らかにする必要がある。1.2 節でも述べるが、 MgB_2 の支配的なピンニングセンタが粒 界であることが示唆されているように、 MgB_2 は F_p が多いことが原因で、磁界中の J_c が 大幅に低下することが問題とされている。しかし、 MgB_2 のピンカは弱く、焼成のみで粒 子サイズを調整するのは容易ではない。より強い粒界にするために、小さい粒子サイズを 得る必要がある。

しかしながら、「比率の異なる MgB_2 線材を作製したところ、B の比率が化学両論的な 比率 Mg:B=1.0:2.0よりも大きい、Mg:B=1.0:2.8という比率で作製した線材試料が、20 K の温度下において高い J_c と F_p を得た。しかし、それよりも B の比率を上げていくと、逆 に F_p は減少していった。粒子サイズは B 組成の増加により、さらに小さくなる傾向があ るが、これは Mg の不足が原因となる粒成長の抑制によりもたらされる。そして、未反応 Mg と B は結果として F_p の減少となる、不純物面と遮蔽電流転送として働くかもしれな い」という Miura ら [4] の論文を読み、 MgB_2 を他の比率に変えることでも大幅に低下す る J_c の改善になるのではないかと考えた。今後幾つかの技術的な成功を経て、 MgB_2 素 線のさらなる高特性化、システムの低コスト化が進めば、 MgB_2 は新しい超伝導材料とし て実用化が進むと考えられる。

本研究においては、Mg:Bの比率の異なる MgB_2 バルク試料を作製し、真空中で焼成を 行った試料での比率の違いにより J_c や T_c への影響を研究する。

1.2 磁束ピンニング機構

第2種超伝導体の混合状態において、損失なしに電流を流すためにはピン力が必要であ ることは述べたが、転移、常伝導析出物、空隙結晶粒界面等あらゆる欠陥や不均一物質が ピン力をもたらすことが知られている。これらをピンニングセンターという。 MgB_2 の場 合では結晶粒界が有効なピンニングセンターとして働くと考えられていたが、実際に結 晶粒径とピンニング特性の定量的な評価がされ、 MgB_2 における支配的なピンニングセン ターが結晶粒界であることが明らかになった [1]。混合状態において、磁束は超伝導体に 量子化して侵入することが知られており、これを量子化磁束という。また超伝導電子の密 度は $|\Psi|^2$ で与えられ、この Ψ をオーダーパラメータという。量子化磁束とオーダーパラ メータの構造は図 1.1 のようになるが、量子化磁束の中心部分はほぼ常伝導状態 ($|\Psi|$) \simeq 0) で、そのサイズはコヒーレンス長 ξ 程度であることが知られており、その部分を常伝導核 と呼ぶ。

ここで λ が ξ よりも十分大きい典型的な第2種超伝導体を考え、孤立した磁束線と大き さLが $\xi \gg L \gg \lambda$ であるような常伝導析出物の相互作用を取り扱うとする。こうした常 伝導析出物のために磁束線の Ψ やBの構造は乱される。しかし、 λ が常伝導析出物より も十分大きいため、Bの乱れは小さく、無視できると考えられる。したがって、この場合 のピンニング相互作用では Ψ の空間変化が主要となる。磁束線の中心から離れた部分で は Ψ が平衡値 Ψ_{∞} に近く、その部分のエネルギー密度は常伝導状態よりもほぼ凝縮エネ ルギー密度だけ低い。言い換えると常伝導核は周囲の超伝導部分よりもエネルギーが高い のである。

ところで、電子の平均自由行程を lとして、 $1/\xi = 1/\xi_0 + 1/l$ のような関係が成り立 つことが知られている。 ξ_0 は非局所性を表す特性距離で BCS 理論により導かれたコヒー レンス長である。 ξ_0 は定数のため、lが減少すれば ξ も減少することが分かる。結晶界面 では電子が感じるポテンシャルが周期性を乱していることから電子が散乱され、平均自由 行程 lの低下を通じてコヒーレンス長 ξ が短くなる。したがって、常伝導核が結晶界面の ところに来るとエネルギーが高い常伝導核が細くなり、エネルギー的に得をする。このた

め結晶界面もまた引力的なピンニング相互作用をする。以上のようなピンニング機構を凝縮エネルギー相互作用と呼ぶ。



図 1.1: 磁束線のオーダーパラメータと磁束密度の構造

1.3 磁束クリープ

磁束ピンニングで決定される実用的な超伝導電流は完全反磁性に関連した超伝導電流と は大きく異なる。すなわち、後者が理想的な永久電流であるが、前者は極めて微小である が時間経過とともに減衰する。超伝導電流が減衰するのは、磁束線がピンにより止めら れた状態が、完全な平衡状態ではなく準平衡状態であり、有限温度下において、熱エネル ギーにより磁束線がピンから外れて動き出す確率がゼロではないためである。こうした磁 束線の熱活性化運動のためにピンニング電流は時間とともにわずかにではあるが減少す る。こうした現象を磁束クリープという。

1.4 不可逆磁界

高温になると磁束線の熱運動が激しくなり磁束クリープの影響が大きくなる。この時、 わずかな電流でも磁束線の運動が顕著になり定常的な電界が観測される。すなわち、臨界 電流密度 J_c が 0 になる。この $J_c = 0$ となる磁界 B_i を不可逆磁界という。また $B_{c2} = 0$ と $B_i = 0$ となる T は T_c である。この不可逆磁界より小さい磁界範囲では、磁化曲線は外部 磁界に対して不可逆となりヒステリシス曲線を示す。これは、ピン力が常に Lorentz 力の 反対に働くため超伝導体に磁束線が入りにくく出にくいことが起因している。また外部 磁界が不可逆磁界より大きい範囲において、磁化曲線はヒステリシスを示さず、可逆とな る。*B-T*平面上における不可逆領域と可逆領域の境の曲線を不可逆曲線という。ピンカの 強い試料ではこの曲線が高温側にシフトする。



図 1.2: 不可逆曲線

1.5 線材化法

1.5.1 PIT法

PIT (powder-in-tube) 法とは、鉄等の金属シース (保護管) の中に試料となる物質を詰め て線引き加工をし、線材とする方法をいう。現在 MgB_2 を製作する時に最も一般的に用い られる線材化の方法である。PIT 法は *in-situ* 法と *ex-situ* 法という 2 つの方法に大別さ れる。

*in-situ*法とは、未反応の物質または化合物を用いて、後で熱処理して反応させながら 線材化を行う方法である。これに対して*ex-situ*法とは、既に反応済みの物質を用いて、

1.5.2 拡散法

よく用いられる線材化法としての PIT 法ではあるが、実際のところ、*in-situ* PIT 法等 で作製した MgB₂ 超伝導体の充填率は 50 パーセント程度と低い。臨界電流特性 J_c は充填 率の影響を大きく受けるため、小さくなってしまう。

in-situ 線材における MgB₂ 超伝導体の充填率が低いことの原因は、Mg 粉末と B 粉末からの MgB₂ の生成過程にある。MgB₂ の生成反応は、低融点かつ蒸発し易い Mg が B 粉末 側に移動して起こるため、Mg 粉末が存在していた領域には反応後にボイドが生成する。 そのため、Mg 粉末と B 粉末を混合して反応させるとボイドの生成が避けられない。そこ で、B 粉末と Mg 粉末を混合せずに隣り合わせに充填して、Mg と B を反応させると、B 粉末側に高密度の MgB₂ 超伝導体が生成する。これが、最近注目を集めている拡散法と呼 ばれる方法である [2]。拡散法で作製された MgB₂ 超伝導体は充填率が高く、従来の線材 に比べて高い J_c を達成している。充填率が向上すれば、組織制御にによる磁束ピンニン グ効果が超伝導体の J_c に及ぼす影響は大きくなると予想される。そのため、出発材料や 熱処理条件等の作製条件の最適化が一層重要になる。

1.5.3 PICT法

PICT (powder-in-closed-tube)法とは *in-situ* 法に属すもので、具体的には図 1.3 に示す ように出発原料とする、Mg 粉末とB 粉末を金属管に詰めた後に金属管の両端を閉じてか ら加工、加熱処理そして生成させる方法である [3]。PICT 法の利点としては、従来の PIT 法に比べ再現性が高いことと臨界電流特性が良いことが挙げられる。



図 1.3: PICT (powder-in-closed-tube) 法

1.6 本研究の目的

2001年に発見された MgB₂ は金属系超伝導体の中で最も臨界温度 T_c が高く、また製造 が容易ということなどからとても期待されている超伝導体である。結晶構造は図 1.4 に 示す。

MgB2の実用化に向けては、高い臨界電流特性や高温での強いピン力等が必要になって くる。MgとBの比率を変えることによっても臨界電流密度や高温での磁界特性等が変わ ることが知られている[4]。

今回の研究では、Mg:Bの比率の異なる MgB2 バルク試料を作製・使用し、比率の違い による臨界電流密度や臨界温度への影響について調べることを目的とする。



図 1.4: MgB₂ の結晶構造

第2章 実験

2.1 試料

現在行われている MgB₂の製造法としては、金属管に粉末を詰め込み作製する PIT 法が 主である。しかし、一般的な PIT 法では物質の充填率が低く、高い J_c を得ることが難し い。そこで今回は、物質の充填率を上げる拡散法と比較的高い J_c が得られやすい PICT 法を組み合わせた、拡散 PICT 法を用いた。

出発原料は純度 99.9 %、200 メッシュの Mg 粉末と純度 99 %、300 メッシュの B 粉末 である。作製時に掛ける圧力に耐えられるものとして、使用したシースは SUS316 管であ る。比率は Mg_xB₂ の組成で x を 0.8 から 1.3 まで変化させた。試料に掛けた圧力は 8 t で あり、一軸方向である。

試料作製手順は、

1. SUS 管を適当な長さに切り取る。

- 2. 粉末がシースから出ないようにするために、シースの片方の端から約3 cm までの部 分に圧力を掛けてシースの口を閉じる。閉じたシースの端を曲げて、さらに圧力を 掛けて端を完全に折り畳む。
- 3. Mg 粉末とB 粉末の重さを計量し、Mg 粉末、B 粉末、Mg 粉末の順に入れて、詰める。
- 4. 充填率を上げるために、口が開いている方の端から Mg 粉末と B 粉末が詰められて いない部分までを圧力を掛けて閉じる。
- 5. 再び閉じたシースの端を曲げて、さらに圧力を掛けて端を完全に折り畳む。
- 6. 充填率を上げるために、Mg粉末とB粉末が詰められている部分に圧力を掛けて、体

積を小さくする。

- 7. 不純物である M_{gO} を作らないために、 M_{g} 粉末と B 粉末を詰めたシースを石英管の中に入れて、石英管の中を減圧し 1.0×10^{-6} Torr にする。
- 8. 減圧している状態の石英管を図 2.1 に示すように、室温から 850 までの温度上昇を
 4 時間、850 の持続時間を 24 時間、850 から 25 までの温度下降を 4 時間に設定して焼成した。
- 9. 焼成した試料を SUS 管から取り出して、 MgB_2 バルク試料が完成する。

表 2.1 に各試料の比率と T_c に示す。

試料	$x (\mathrm{Mg}_x \mathrm{B}_2)$	$T_{\rm c}$ [K]
#1	0.8	38.57
#2	0.9	38.51
#3	1.0	38.54
#4	1.1	38.61
#5	1.2	38.71
#6	1.3	38.72

表 2.1: 試料の比率



図 2.1: 試料の焼成温度と焼成時間

2.2 実験方法

本実験では作製した MgB_2 の臨界電流密度 J_c 、臨界温度 T_c を測定するため、SQUID 磁力計 (MPMS-7) を用いた。以下にこれらの測定法について示す。

2.2.1 SQUID 磁力計による直流磁化法

直流磁化測定では、ある一定温度で外部磁界を最初にマイナス1Tを印加し、0Tから 7Tまで増磁する。そして、7Tから0Tまで減磁し、直流磁化を測定することにより、磁 化のヒステリシス曲線を得る。ある磁界における磁化のヒステリシスの幅 ΔM [emu]が臨 界電流密度に比例することにより、このヒステリシス曲線から測定温度下における臨界電 流密度の外部臨界依存性([J_c -B])が求まる。ここで長さl、幅wの平板状超伝導体(l > w) の試料の広い面に垂直に磁界を加えた場合について考える。図 2.2のように試料に座標を 設け、試料の幅方向をx軸、長さ方向をy軸、広い面に垂直な方向をz軸とし、試料の中 心を原点とする。四方向から試料へ磁束が侵入し、これを遮蔽する電流は、臨界電流密度 が等方的ならば、Bean モデルを仮定すると図 2.2の試料の端から一定の距離のところを 流れる環状電流となる。この位置を中心から $x \sim x + dx$ とすると、微小幅 dx 及びに z 軸 方向のサイズ dz を流れる微小電流は $dI_c = J_c dx dz$ である。この環状電流に囲まれた領域 の面積は

$$S = 4x^2 + 2x(l - w)$$
(2.1)

となる。また、この微小電流により発生する磁気モーメントは $dm = S dI_c$ となる。よって試料全体の磁気モーメントは

$$m = \int \mathrm{d}m = \int \int S(x) J_{\mathrm{c}} \mathrm{d}x \mathrm{d}z = J_{\mathrm{c}} d \int S(x) \mathrm{d}x$$
(2.2)

となる。ただし、 d は磁界の方向の試料の厚みである。これを計算すると

$$m = \frac{J_{\rm c} w^2}{12} (3l - w)d \tag{2.3}$$



図 2.2: 四方向から磁束線が侵入した場合の流れ方と電流が流れる微小幅 dxの帯に囲まれた領域

となる。図 2.3 の下半分は増磁過程の磁束密度の空間分布で上半分は減磁過程の磁束密度 の空間分布となっており、空間分布の端部にかかる磁界が $H_{\rm e}$ である。したがって超伝導 体の磁化のヒステリシスの幅 ΔM に相当する磁気モーメント Δm は、式 (2.3) より、

$$\Delta m = \frac{J_{\rm c} w^2}{6} (3l - w)d \tag{2.4}$$

となる。したがって磁化のヒステリシスは△mを超伝導体の体積で割って

$$\Delta M = \frac{J_{\rm c}w}{6l}(3l - w) \tag{2.5}$$

となり、臨界電流密度は

$$J_{\rm c} = \frac{6l}{w(3l-w)} \Delta M \tag{2.6}$$

から評価される。なお、SQUID 磁力計から得られる磁化の測定値は [emu] であるので、これを SI 単位系に換算するために以下の式を用いた。

$$\Delta M[\mathrm{A/m}] = \Delta M[\mathrm{emu}] \times 10^3 \tag{2.7}$$



図 2.3: 四方向から磁束線が侵入した場合の増磁過程(下)と減磁過程(上)における磁束密度の空間分布

第3章 実験結果と検討

3.1 *J*_c-*B*特性

図 3.1 に SQUID 磁力計による直流磁化法で表 2.1 に示す Mg:B 比で作製した各試料の 20 K の J_c -B 特性の結果を示す。この結果から、化学量論的な Mg:B = 1.0:2.0を基準 として Mg 比が低い試料と Mg 比が高い試料に分けて考える。

低磁界側では Mg 比の低い試料が比較的高い J_c と見せているが、高磁界側では Mg 比の 高い試料の J_c の低下が比較的緩やかとなる。図 3.2 に 1 T の場合、図 3.3 に 3 T の場合の Mg_xB_2 の各試料の J_c を示した。1 T の磁界下では Mg の割合が小さい試料から順に高い J_c が見られた。3 T の磁界下では Mg の割合が少し大きい試料から高い J_c が見られた。し かし、 Mg の比率が最も大きい試料は J_c はいずれの磁界においても低い J_c を見せた。ま ず Mg 比が低い試料について考えられることは、 Mg の比率が低いとそれだけ MgO の生 成される確率が低くなり、充填率が高くなる。その結果、低磁界では、電流阻害原因でも ある不純物も少ないため高い J_c を得ている。一方で、 Mg 比が基準より高い試料の J_c 特 性について考えられることは、 Mg の比率が高いとそれだけ MgO の生成される確率が高 くなり、充填率が低くなる。その結果、低磁界では電流阻害原因でもある不純物が多いた め低い J_c になっている。しかし、高磁界では Mg を多く入れることで、何らかのピンが 多く発生したことで、 J_c の低下が抑えられたものと考えられる。



図 3.1: 各試料の Jc-B 特性



図 3.2: 1 T での各試料の Mg 量に対する Jc



図 3.3: 3 T での各試料の Mg 量に対する Jc

3.2 *F*_p-*B*特性

図 3.4 に各比率の試料の規格化した F_p-B 特性を示す。高磁界では Mg の比率の高い試料の規格化 F_p が比較的高いことが示される。このことからもピンとなる物質がより多く 生成されていることが考えられる。



図 3.4: 各試料の規格化 $F_{\rm p}$ -B 特性

第4章 まとめ

本研究を通して、Mg:Bの比率を変えることによっても J_c に影響を与えることが分かった。 Mgの比率が化学量論より低い試料の低磁界においての J_c が高いことが分かった。これは Mg の比率が低いと不純物 MgO の生成される確率が低くなり、MgB₂ の充填率が高くな ることが考えられる。Mg の比率が化学量論より高い試料の高磁界においての J_c の低下が 抑えられていることが分かった。これは Mg の比率が多く入れることでピンとなる物質が 生成されて、磁界依存性が強くなったと考えられる。図 3.4 において、Mg:B = 1.1:2.0 の試料のピンカのピークが他の比率よりも高磁界側にあることからも、高磁界において本 研究の試料中で最も高い J_c を出した何らかのピンの存在が考えられる。

今後の課題としては、Mg: B = 1.1: 2.0の磁界依存性を上げる様なピンが存在するの か、そして存在していれば、どのようにすれば生成されるのかを調べる必要がある。それ に関係して、作製された試料の X 線回折によって試料中の化合物等の存在を確認し、ピ ンとなる物質の同定を行う必要がある。そして、そうしたピンを増やすために Mg と B の 割合をさらに詳細に変化させ、ピンの発生を最も促す焼成温度と焼成時間も探していくこ とが今後の J_c 特性への影響を調べる上でも重要となってくる。

謝辞

本研究を行うにあたり、多大なご指導と助言をして頂いた松下照男教授に深く感謝いた します。また小田部荘司教授、木内勝准教授ならびに谷川潤弥さんには実験や論文作成に あたって様々な御協力を頂き深く感謝いたします。最後に、公私共々お世話になりました 松下研究室・小田部研究室・木内研究室所属の皆様に深く感謝いたします。

関連図書

- Y. Katshura, A. Yamamoto, I. Iwayama, S. Horii, J.Shimoyama and K. Kishio: Grain Size Determinants and Grain-Boundary Pinning in In-situ MgB₂ Bulks
- [2] Y. Shimada, T. Ohashi, S. Hata, K. Ikeda, H. Nakashima, T. Mochizuki, J. Shimoyama, S. Horii and K. Kishio: Influences of Microstructure on Critical Current Properties in MgB₂ Superconducting Bulk Fabricated using a Premix-PICT Method
- [3] A. Yamamoto, J. Shimoyama, S. Ueda, Y. Katshura, S. Horii and K. Kishio: Supercond. Sci. Technol. 17(2004) 921-925
- [4] O. Miura, A. Saeki, H. Tomioka, D. Ito, N. Harada: Physica C 463-465 (2007) 812-816